# (19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-164938 (P2000-164938A)

(43)公開日 平成12年6月16日(2000.6.16)

(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ		テーマコード(参考)
H01L 33/00		H01L 33/00	N	5 F O 4 1
H01S 5/022		HO1S 3/18	612	5F073

## 審査請求 未請求 請求項の数6 OL (全8 頁)

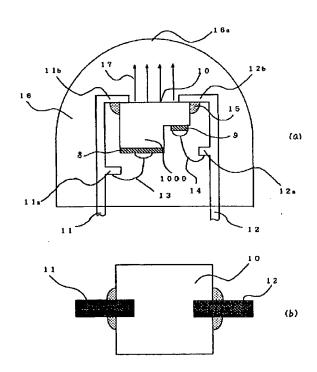
(21)出願番号	特願平10-337455	(71) 出願人 000005049
		シャープ株式会社
(22)出顧日	平成10年11月27日(1998, 11, 27)	大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号
		(72)発明者 幡 俊雄
		大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
		ャープ株式会社内
		(74)代理人 100103296
		<b>弁理士 小池 隆彌</b>
		Fターム(参考) 5F041 AA41 AA42 AA44 CA40 CA91
		CB15 DA01 DA25 DA44 DB01
		EE11
		5F073 CA21 FA04 FA30
		i e

# (54) 【発明の名称】 発光装置及び発光素子の実装方法

## (57)【要約】

【課題】 外部発光効率及び寿命が良好な基板裏面を発 光透光面とする窒化ガリウム系化合物半導体が実現する ことを提供する。

【解決手段】 基板 (発光透光面)端部とリードフレー ムのダイバッドを一部固定、または基板周囲端部とリー ドフレームのダイパッドを固定する実装方法とし、ダイ パッドの裏面側から発生光を出射する。さらに、素子構 造は、発光層の基板と反対側に窒化物半導体からなる多 層反射層を設ける、素子の上面さらに側面に絶縁体多層 膜または絶縁体層と金属反射層を設けることにより、発 光層から上面と側面に向かう発生光を基板側に反射させ る素子構造とし、基板裏面を発光透光面とする外部発光 効率及び寿命が良好な窒化ガリウム系化合物半導体が実 現することを提供する。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 発光を透過する基板と、該基板上に窒化物半導体からなる発光層を含む半導体層と、該半導体層上に設けられた正及び負電極とを備えた発光素子であって、前記基板側と発光装置の光出射面とが対向するように、前記基板がリードフレームのダイバッド部に固定され、前記正及び負電極とリードフレームとがワイヤで接続されてなるととを特徴とする発光装置。

【請求項2】 前記発光素子は、基板裏面以外の表面近 傍に、発光層からの発光を内部に反射させる構造を備え 10 ることを特徴とする、請求項1に記載の発光装置。

【請求項4】 前記発光素子は、基板上に少なくとも一対のクラッド層と、該クラッド層に挟まれた窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光層を有する発光素子であって、前記発光層上に形成された電極が発光を透過する金属膜で構成され、該電極上に発光層からの発光を反射する、絶縁体多層反射膜を備えることを特徴とする、請求項2 に記載の発光装置。

【請求項5】 前記発光素子は、基板上に少なくとも一対のクラッド層と、該クラッド層に挟まれた窒化ガリウム系化合物半導体からなる発光層を有する発光素子であって、前記発光層上に形成された電極が発光を透過する金属膜で構成され、該電極の上に絶縁体層を介して発光層からの発光に対して光反射率の高い金属膜を備えることを特徴とする請求項2に記載の発光装置。

【請求項6】 先端部にダイバット部を備えるとともに、このダイバッド部より発光素子の厚さ以上後方にリードバット部を備えた第1 および第2のリードフレームと、基板上に発光層を含む半導体層と、この半導体層上に設けられた正および負の電極を備えた発光素子とを用 40 意し、前記ダイバット部に前記発光素子をダイボンドし、その後前記正および負の電極と前記リードバッド部をワイヤボンドすることを特徴とする発光素子の実装方法

# 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明が属する技術分野】本発明は窒化物半導体(例えば、窒化ガリウム系化合物半導体InxAlvGa<sub>1-x-v</sub>N,0≤x,0≤y,x+y≤1)よりなる半導体発光素子を用いた発光装置及び発光素子の実装方法に関し、

特に、基板側を発光透光面とする窒化物半導体発光素子 を用いた発光装置に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に窒化物半導体発光素子は、絶縁性基板上に窒化物半導体層を積層して構成するため、p型電極とn型電極を同一面側に形成している。n型電極の形成は、p型窒化物半導体層側からエッチングして、n型窒化物半導体層表面を露出させ、この上にn型電極を形成しているために、p型電極とn型電極の高さが同一ではなく、発光ダイオードおよびレーザにおいては一般にn型電極がp型電極に対して1μm程度低い位置に形成されている。前記窒化物半導体発光素子から外部に光を取り出す方法として、基板側を発光透光面とする方法がある。この実装方法は、前記半導体発光素子上に形成された、高さの違うp型電極とn型電極をリードフレームの電極に電気的に接続する実装方法である。

【0003】例えば、p型電極とn型電極の段差に合うようにヒートシンク上にも段差を設けて、窒化物半導体発光素子を載置することが特開平9-181394号公報に開示されている。図8はその実装模式図を示し、窒化物半導体発光素子70の一方側にp型電極71と、n型電極72が形成されている。このp型電極71とn型電極72の段差に合わせてヒートシンク73を段差部700が設けている。n型電極72とリード電極75及びp型電極71とリード電極74は、導電性材料77により接続されている。

【0004】また、p型電極とn型電極の高さを一致させて実装する方法が特開平6-177434号公報に開示されている。図9はその模式図を示し、窒化物半導体発光素子79に厚いn型電極80、薄いp型電極81を形成してn型電極80とp型電極81の表面の高さを一致させ、その周囲を絶縁性保護膜82で被覆している。そしてn型電極80とリードフレーム85及びp型電極81とリードフレーム86は導電性接着剤層83、84により接続されている。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】図8に示したように、 室化物半導体発光素子70のp型電極71とn型電極7 2の段差に合わせて、ヒートシンク73に段差部700 を設けて載置する方法では次のような問題がある。段差 部700の設けられたヒートシンク73上に、前記室化 物半導体発光素子70を載置する際に、半導体発光素子 70上に形成されたp型電極71、n型電極72と段差 部700を有するヒートシンク73上にリード電極7 4、75を同時に接続するには、非常に高いダイボンド 精度が必要とされる。とのため、製造が困難であるとい う問題があった。

【0006】また、図9に示したように、p型電極81 とn型電極80の高さを一致させるために、n型電極8 50 0を厚く形成して窒化物半導体発光素子79をダイボン 光層の間に、少なくとも2種の窒化物半導体層が入/4 n1と入/4n2膜厚(入は波長、n1, n2は波長に 対する屈折率)からなる多層膜を積層することにより、 前記発光層から発生し上方に向かう発生光を前記電極で の吸収や散乱を防止し、前記多層膜により効率よく基板 側に反射させることにより、基板を発光透光面とする、 外部発光効率の良好な窒化ガリウム系化合物半導体発光

素子が可能となる。前記2種の窒化物半導体層は外部からの電流を注入するために p型不純物または n型不純物 がドープされた層が好ましく、前記多層膜の積層数は、2層を一対として10対以上100対以下が好ましい。 10対未満では十分な反射率が得られず、100対より大きくすると前記多層膜の直列抵抗が大きくなり、発光素子の駆動電圧が大きくなるため好ましくない。前記2種の窒化物半導体層は、 $1n_xAl_yGa_{1-x-y}N$ ( $0 \le x, 0 \le y, x+y \le 1$ )から構成され、好ましくはG

に問題が生ずる。

【0012】本発明の第2の窒化ガリウム系化合物半導 体発光素子は、絶縁性基板上に少なくとも一対のクラッ ド層及び発光層を有する窒化ガリウム系化合物半導体発 光素子であって、発光層の絶縁性基板とは反対側の半導 体層上に薄膜電極と、この上に少なくとも2種の絶縁体 層が $\lambda/4$  n 1 と $\lambda/4$  n 2 膜厚( $\lambda$  は波長、 n 1, n 2は波長に対する屈折率)からなる絶縁体多層膜、さら にこの上にバッド電極を積層することにより、発光層か ら発生し上方に向かう光を前記パッド電極での吸収や散 乱を防止することができる。前記絶縁体多層膜は、窒化 ガリウム系化合物半導体発光素子の側面及び基板と反対 側の面を覆うように形成されているため、前記発光層か ら発生し上方及び側面に向かう発生光を基板側に反射さ せることにより基板を発光透光面とする、外部発光効率 の良好な窒化ガリウム系化合物半導体発光素子が可能と なる。ととで、前記2種の絶縁体多層膜は高屈折率材料 膜としてはA1,O,、CeF,、CeO,、HfO,、M gO, Nd,O,, NdF,, PbO, Pr,O11, Sc, O,、TiO,、TiO、Y,O,、ZrO,等、低屈折率 材料膜としてはCaF,、MgF,、LaF,、LiF、

【0013】本発明の第3の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、絶縁性基板上に少なくとも一対のクラッド層及び発光層を有する窒化ガリウム系化合物半導体発光素子において、発光層の絶縁性基板とは反対側の半導体層上に薄膜電極と、この上に少なくとも1種の絶縁体層と光反射率の高い金属が窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の側面及び基板と反対側の面を覆うように多層

MgF<sub>2</sub>、Na<sub>3</sub>AlF<sub>6</sub>、NaF、SiO<sub>2</sub>、Si<sub>2</sub>O<sub>3</sub>等

ドするか、前記窒化物半導体発光素子79をダイボンド・する際に厚い導電性材料83、84によりヒートシンクに載置する方法では次のような問題がある。n型電極80を厚く形成するには、発光ダイオードおよびレーザにおいては1μm程度にn型電極80を厚く形成する必要があるが、厚い電極を形成するのには製造工程が複雑になる問題がある。さらに、前記導電性材料を厚く形成すると、前記窒化物半導体発光素子をダイボンドする際にp型電極とn型電極の周囲からはみ出した導電性材料により電極間が短絡しやすくなり、製造歩留まりが非常に10悪くなるという問題があった。

【0007】さらに、いずれの方法においても、ダイボンドの際に半導体層側を接着材例えば、銀ペースト、半田等により固定されているために、歪が発生し、ひいては窒化物半導体発光素子の寿命を劣化させるという問題があった。

【0008】また、従来の発光素子では、半導体層上に 形成された電極のために、外部への出射光が吸収、散乱 されるため光を外部に取り出す効率が低下するという問 題もあった。

【0009】以上のように、外部発光効率の向上ひいて は素子の寿命の向上が期待される窒化物半導体発光素子 は、実現が困難であった。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明は、窒化ガリウム 系化合物半導体発光素子において、絶縁性基板の端部を リードフレームのダイバッド部に固定してなる実装構 造、あるいは前記絶縁性基板の周囲の端部をリードフレ ームのダイバッド部に固定してなる実装構造とし、これ によりダイパッド部の裏面側を通して、絶縁性基板から の出射光を効率よく取り出す構造とする。また窒化物系 半導体発光素子上に形成されたり型電極、n型電極とリ ードフレーム上のリードパッド部をリード線により電気 的に接続するため、電極間の短絡問題をなくす。さら に、ダイパッド部に発光素子の基板側を固定する際に絶 縁性接着材を用いるため、リードフレームと発光素子の 電気的短絡が無くなり、生産性の向上した窒化ガリウム 系化合物半導体発光素子を提供する。前記絶縁性接着材 は、例えば無色で透明な窒化ガリウム系化合物半導体発 光素子の発光波長である短波長領域において光の透過率 40 が90%以上あるようなエポキシ系樹脂、ポリエステル 系樹脂、シアノアクリル系樹脂等が好ましい。さらに、 発光素子の基板側をダイパッド部に固定するため、接着 材による発光素子への歪が低減され、ひいては窒化ガリ ウム系化合物半導体発光素子の寿命を延ばすことが可能 となる。

【0011】本発明の第1の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子は、絶縁性基板上に少なくとも一対のクラッド層及び発光層を有する発光素子であって、発光層の絶縁性基板とは反対側の半導体層上に形成された電極と発 50

30

に積層され、前記発光層から発生し上方及び側面に向か う発生光を基板側に反射させることにより基板を発光透 光面とするように機能させる窒化ガリウム系化合物半導 体発光素子を作製することにより、外部発光効率の良好 な窒化ガリウム系化合物半導体発光素子ができる。とと で、前記光反射率の高い金属は、アルミニウム(Al) や銀(Ag)が可視光領域において光反射率が高いので 好ましい。

### [0014]

【発明の実施の形態】本発明は窒化物半導体(特に、例 10  $\lambda U I n_x A l_y G a_{1-x-y} N$ ,  $0 \le x$ ,  $0 \le y$ , x + y≦1)よりなる発光素子に関し、基板を発光透光面とす る窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の素子構造及び その実装方法を以下に図面を参照しながら詳細に説明す るが、以下の実施の形態に限定されるものではない。ま た実施の形態1~3の発光素子はLEDランプを構成し ているが、レーザに適用することも可能である。また実 施の形態1~3の素子構造と実施の形態1~3のリード フレームの組み合わせは任意に変更することができる。 【0015】ととで、本発明の実施の形態1、実施の形 20 態2、実施の形態3の窒化ガリウム系化合物半導体発光 素子の製造方法においては、有機金属気相成長法(以下 MOCV D法と呼ぶ)を用い、V族原料としてアンモニ アNH3、III族原料としてトリメチルガリウム、ト リメチルアルミニウム、トリメチルインジウム、P型不 純物としてビスシクロペンタディエニルマグネシウム (Cp,Mg)、N型不純物としてモノシランを用い、 キャリヤガスとして水素及び窒素を用いた。

【0016】(実施の形態1)図1(a)に本発明の素 子構造1000を実装したLEDランプの模式図を示 す。本発明の素子構造1000を実装するリードフレー ムは、正電極用リードフレーム11と負電極用リードフ レーム12からなり、各リードフレームはそれぞれリー ドパッド11a、12a、ダイパッド11b、12bを 備える。本発明の素子構造1000は、絶縁性接着材例 えば、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂、シアノア クリル系樹脂等の接着材15によりダイパッド11bと 12bに固定され、p型電極8とリードパッド1laが リード線 1 3 により接続され、n 型電極 9 とリードバッ ド12aがリード線14により接続される。最後に、エ 40 ポキシ樹脂等により全体をレンズ形状16にしてモール ドを形成して、これにより、窒化ガリウム系化合物半導 体発光素子よりなる発光装置としてのLEDランプを完 成する。ととで、発光透光面10とレンズ形状の領域1 6aは対向するように組み立てられることにより、発光 透光面10からの発生光17が効率よくレンズ形状16 から外部に出射される。

【0017】さらに、図1(b)は基板側(発光透光 面) からみたリードフレーム形状とリードフレーム上に 窒化ガリウム系化合物半導体発光素子が載置された模式 50 ムは、正電極用リードフレーム11と負電極用リードフ

図を示す。発光透光面10の一部がダイバッド11b及 び12bに、例えば、エポキシ系樹脂、ポリエステル系 樹脂、シアノアクリル系樹脂等の接着材15により固定 され、基板側(発光透光面10)から外部に効率よく光 を取り出すことができる、ダイパッド形状とする。こと で、p型、n型電極をリード線13、14にて正電極用 リードフレーム11、負電極用リードフレーム12と接 続しているため、従来の導電性接着材を用いてp型、n 型電極と接続していた実装方法に比較して、電極間の短 絡不良が無くなった。さらに、基板をダイパッドに固定 するため接着材による半導体層への歪の影響が低減さ れ、信頼性の良好な窒化ガリウム系化合物半導体が得ら

【0018】図2は本発明の実施の形態1の窒化ガリウ ム系化合物半導体発光素子の模式断面図を示す。本発明 の素子構造1000は、サファイヤ製の基板1上に、A 1Nバッファ層2厚さ500A、n型GaN層3厚さ5 μm、n型Aloos Gaores Nクラッド層4厚さ0.3 μm、ノンドープIno.32 Gao.68 N量子井戸層5厚さ 30A、p型A 1。。。Ga。。, N蒸発防止層6厚さ20 nm、p型GaN層100とp型A1。,Ga。。N層1 01が40組からなる多層反射膜が順に積層されてい る。次に、p型電極8、n型電極9を形成する。その 後、ウエハーをダイシングによりチップ状にカットし発 光素子を得る。ことで、前記発光層の波長が460nm においては、p型GaN層100厚さ47nmとp型A 1... Ga... N層101厚さ49nmが40組からなる 多層反射膜が積層されている。これにより、本発明の素 子構造となる。

【0019】本発明の素子構造は以上のように構成され るから、正電極用リードフレーム11と負電極用リード フレーム12の端子に電源を接続することにより、外部 から本発明の発光装置であるLEDランプに電流を供給 することができる。発光層からの出射光は基板と反対側 に窒化物半導体からなる多層反射膜を積層することによ り、前記発光層から発生し図2の上方に向かう発生光を 基板側に反射させて基板を発光透光面とし、基板と反対 側に形成されているp型電極8、n型電極9による吸収 や散乱の影響を防止することができるため、外部に効率 よく光を取り出すことができる。

【0020】本発明の発光装置の構造及び実装方法によ れば、前記発光層から発生し基板と反対側の半導体層上 に形成された電極方向に向かう発生光を基板側に反射さ せることにより、外部発光効率が良好で、電極間での短 絡不良も抑えられた基板面を発光透光面とする窒化ガリ ウム系化合物半導体が実現できる。

【0021】(実施の形態2)図3(a)は本発明の素 子構造2000を実装したLEDランプの模式図を示 す。本発明の素子構造2000を実装するリードフレー

レーム12からなり、各リードフレームはそれぞれリー ドパット11a、12aダイパッド11b、12bを備 える。本発明の素子構造2000は、絶縁性接着材例え ば、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂、シアノアク リル系樹脂等の接着材15によりダイパッド11bと1 2 b に固定され、パッド電極8 b とリードパッド11 a がリード線13により接続され、n型電極9とリードパ ッド12aがリード線14により接続される。最後に、 エポキシ樹脂等により全体をレンズ形状16にしてモー ルドを形成して、これにより、窒化ガリウム系化合物半 10 導体発光素子よりなるLEDランプを完成する。こと で、発光透光面10とレンズ形状の領域16aは対向す るように組み立てられることにより、発光透光面10か らの発生光17が効率よくレンズ形状16から外部に出 射される。 図3(b)は基板側(発光透光面)からみ たリードフレーム形状とリードフレーム上に窒化ガリウ ム系化合物半導体発光素子が載置された模式図を示す。 発光透光面10の端部が、T字形のダイバッド11b、 12 bに、例えば、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹 脂、シアノアクリル系樹脂等の接着材15により固定さ れ、基板側(発光透光面10)から外部に効率よく光を 取り出すことができる、ダイバッド形状とする。ここ で、p型、n型電極をリード線13、14にて正電極用 リードフレーム11、負電極用リードフレーム12と接 続しているため、従来の導電性接着材を用いてp型、n 型電極と接続していた実装方法に比較して、電極間の短 絡不良が無くなった。さらに、チップの基板1が絶縁性 接着材15により固定されるため、実施の形態1と同様 に半導体層への歪が低減され、素子の寿命がより良好と

【0022】図4は本発明の実施の形態2の窒化ガリウ ム系化合物半導体発光素子の模式断面図である。本発明 の素子構造2000は、サファイヤ基板1上に、A1N バッファ層2厚さ500A、n型GaN層3厚さ5μ m、n型A l o.os G a o.os Nクラッド層4厚さ0. 2 μ m、ノンドープIn。.s2Ga。.s.N量子井戸発光層5厚 さ30A、p型A1。。。Ga。。。N蒸発防止層6厚さ4 Onm、p型GaNコンタクト層7厚さ0.5μmが順 に積層され、p型薄膜電極8aとパッド電極8b、n型 電極9から構成されている。さらに、ウエハーをダイシ 40 ングによりチップ状にカットし、発光素子を得る。次 に、前記発光層の波長が565nmにおいては、前記2 種の絶縁体層はSi〇,膜200厚さ100nmとTi O<sub>2</sub>膜201厚さ47nmからなる絶縁性多層膜を10 組形成する。前記絶縁性多層膜のSiO,とTiO,の形 成方法は、通常の電子ビーム蒸着法やスパッタリング法 を用いて、本発明の素子2000の側面及び基板と反対 側の面を覆うように2種の絶縁体層を形成する。このた め、前記発光層から発生し上方に及び側面に向かう発生 光を基板側に反射させることにより基板を発光透光面と 50 構造3000は、サファイヤ基板1上に、A1Nバッフ

し、外部に効率よく取り出すことができる。p型薄膜電 極8 a と n 型電極9 上の前記絶縁体層をフッ酸系エッチ ング液にて除去し、外部から電流を供給するための開口 部を形成して、p型薄膜電極8a上にバッド電極8bを 形成し、これにより、本発明の素子構造とする。

【0023】本発明の素子構造及び実装方法は以上の通 りであるから、正電極用リードフレーム11と負電極用 リードフレーム12の端子に電源を接続することによ り、外部から本発明のLEDランプに電流が供給すると とができる。発光層から出射光は図4の上方つまり基板 と反対側に形成された電極方向と側面に向かう発生光も 基板側に反射させることができるため、実施形態1の外 部光取り出し効率よりも良好な基板側を発光透光面とす る窒化ガリウム系化合物半導体が実現できる。

【0024】(実施の形態3)図5(a)に本発明の素 子構造3000を実装したLEDランプの模式図を示 す。本発明の素子構造3000を実装するリードフレー ムは、正電極用リードフレーム11と負電極用リードフ レーム12からなり、正電極用リードフレーム11はリ ードパッド11aとロ字形のダイパッド11bを備え、 負電極用リードフレーム12はリードパッド12aのみ を備える。本発明の素子3000は絶縁性接着材例え ば、エポキシ系樹脂、ポリエステル系樹脂、シアノアク リル系樹脂等の接着材15によりダイバッド11bに固 定され、パッド電極8bとリードパッド11aがリード 線13により接続され、n型電極9とリードパッド12 aがリード線14により接続され、外部から本発明の発 光素子に電流が供給される。最後に、エポキシ樹脂等に より全体をレンズ形状16にしてモールドを形成して、 30 とれにより、窒化ガリウム系化合物半導体発光素子とす る。ととで、発光透光面10とレンズ形状の領域16a が対向するように組み立てられることにより、発光透光 面10からの発生光17が効率よくレンズ形状16から 外部に出射される。

【0025】図5 (b) に基板側 (発光透光面) からみ たリードフレーム形状とリードフレーム上にチップが載 置された模式図を示す。発光透光面10の周囲端部が、 ロ字形のダイパッド11bに、例えば、エポキシ系樹 脂、ポリエステル系樹脂、シアノアクリル系樹脂等の絶 縁性接着材15により固定され、基板側(発光透光面1 0)から外部に効率よく光を取り出すことができる、ダ イバッド形状とする。ここで、p型、n型電極をリード 線にて正電極用リードフレーム11、負電極用12と接 続しているため、従来の導電性接着材を用いてp型、n 型電極と接続していた実装方法に比較して、電極間の短 絡不良が無くなった。

【0026】図6は本発明の実施の形態3のリードフレ ームのダイバッド11bに載置される窒化ガリウム系化 合物半導体発光素子の模式断面図である。本発明の素子

できる。

ァ層2厚さ500A、n型GaN層3厚さ5μm、n型 AlogosGaogos Nクラッド層4厚さ0. 3μm、ノン ドープ I n。。。 G a 。。 4 N 量子井戸発光層 5 厚さ30 A、p型Al。。。Ga。。N蒸発防止層6厚さ60n m、p型GaNコンタクト層7厚さ0.5μmが順に積 層され、p型薄膜電極8a及びパッド電極8b、n型電 極9から構成されている。その後、ウエハーをダイシン グによりチップ状にカットし、発光素子を得る。次に、 前記発光層の波長が575nmにおいては、絶縁体Si O<sub>2</sub>膜300厚さ0.15μmと金属反射A1膜301 厚さ0.1μmを形成する。前記絶縁性多層膜のSiO ,やA1の形成方法は、通常の電子ビーム蒸着法やスパ ッタリング法を用いる。本発明の素子3000の側面及 び基板と反対側の面を覆うように絶縁体層としてのSi O<sub>2</sub>膜300と金属反射A1膜301が形成されことに より、前記発光層から発生し上方さらに側面に向かう発 生光を基板側に反射させることにより基板を発光透光面 とし、外部への光の取り出し効率が優れた発光素子がで きる。次に、p型薄膜電極8aとn型電極9上の前記絶 縁体層300をフッ酸系エッチング液にて除去し、次 に、金属反射A1膜301を除去しパッド電極8bを形 成し、これにより、本発明の素子構造となる。

【0027】図7は、本発明の実施の形態3で用いられるリードフレームの斜視図を示している。窒化ガリウム系化合物半導体発光素子(図示せず)が、リードフレームのロ字形のダイパッド11bと基板1が絶縁性接着材15により固定され、このことよりダイパッド11bの開口部から光が出射される。実施の形態1及び2と同様に基板側を接着材にて固定するため、半導体層への歪が低減され、素子の寿命がより良好となった。

【0028】 ここで、実施の形態2と同様に絶縁体多層膜を用いて素子の側面、上面から光を反射させる場合に比較して、発光波長が長波長になると絶縁体多層膜での吸収が無視できなくなるため、発光波長が長波長の場合は金属反射層により素子の側面、上面から光を反射させるのがより好ましい。

【0029】本発明の素子構造及び実装方法にて、前記 発光層から発生し上方さらに側面に向かう発生光を基板 側に反射させることにより、発光波長が長波長の場合に おいても外部発光効率が良好で、基板面を発光透光面と 40 する窒化ガリウム系化合物半導体が実現できる。

## [0030]

【発明の効果】本発明の素子構造及び実装方法にて、前記発光層から発生し上方さらに側面に向かう発生光を基板側に反射させることにより、外部発光効率が良好な基板裏面を発光透光面とする窒化ガリウム系化合物半導体が実現でき、さらに、本発明の実装方法によれば、電極間での短絡不良が抑えられ、生産性が向上した基板裏面を発光透光面とする窒化ガリウム系化合物半導体が実現

【図面の簡単な説明】

【図1】実施の形態1のLEDランプの実装模式図を示す。

10

【図2】実施の形態1に載置した窒化ガリウム系化合物 半導体発光素子の断面模式図を示す。

【図3】実施の形態2のLEDランプの実装断面模式図を示す。

【図4】実施の形態2に載置した窒化ガリウム系化合物 10 半導体発光素子の断面模式図を示す。

【図5】実施の形態3のLEDランプの実装断面模式図を示す。

【図6】実施の形態3に載置した窒化ガリウム系化合物 半導体発光素子の断面模式図を示す。

【図7】実施の形態3のリードフレームの斜視図を示 \*

【図8】従来の窒化ガリウム系化合物半導体発光素子の 実装断面模式図を示す。

【図9】従来のフリップチップ型窒化ガリウム系化合物 20 半導体発光素子の実装断面模式図を示す。

【符号の説明】

- 1 サファアイヤ基板
- 2 AINバッファ層
- 3 n型GaN層
- 4 n型AlGaN層
- 5 ノンドープIn Ga N量子井戸発光層
- 6 p型AlGaN蒸発防止層
- 7 p型GaNコンタクト層
- 8 p型電極
- 30 8 a p型薄膜電極
  - 8b パッド電極

10 発光透光面

- 9 n型電極
- 11 正電極用リードフレーム
- 11a、12a リードパッド
- 11b、12b ダイパッド
- 12 負電極用リードフレーム
- 13、14 リード線
- 15 接着材
- |0 16 レンズ形状のランプ
  - 100 p型GaN層
  - 101 p型AlGaN層
  - 200 高屈折率絶縁体層
  - 201 低屈折率絶縁体層
  - 300 絶縁体層
  - 301 金属反射層
  - 1000 実施形態1に載置した素子構造
  - 2000 実施形態2に載置した素子構造
  - 3000 実施形態3に載置した素子構造

